# Present status of Laser Undulator Compact X-ray source (LUCX)

Masafumi Fukuda<sup>1,A)</sup>, Sakae Araki<sup>A)</sup>, Yasuo Higashi<sup>A)</sup>, Koichiro Hirano<sup>2,A)</sup>, Yosuke Honda<sup>A)</sup>, Toshiya Muto<sup>3,A)</sup>

Kazuyuki Sakaue<sup>B)</sup>, Noboru Sasao<sup>C)</sup>, Liu Shengguang<sup>A)</sup>, Mikio Takano<sup>D)</sup>, Takashi Taniguchi<sup>A)</sup>,

Nobuhiro Terunuma<sup>A)</sup>, Junji Urakawa<sup>A)</sup>, Yoshio Yamazaki<sup>4,A)</sup>, Hirokazu Yokoyama<sup>C)</sup>

<sup>A)</sup> High Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-0801, Japan

<sup>B)</sup> Advanced Research Institute for Science and Engineering, Waseda University

17 Kikui-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0044, Japan

<sup>C)</sup> Facility of Science, Kyoto University

Oiwake-Cho, Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8502, Japan

<sup>D)</sup> Saube Co., Ltd.

3-17-3 Hanabatake, Tsukuba-shi, Ibaraki, 300-3261, Japan

#### Abstract

We have developed a high flux X-ray generator via inverse Compton scattering of an e<sup>-</sup> beam and a high power pulsed laser beam with a pulsed-laser stacking cavity. The merit of this method is that a compact and inexpensive X-ray generator can be constructed because this generator can obtain the X-ray of the same energy with e<sup>-</sup> beam of a lower energy in comparison with a synchrotron radiation facility using a GeV order storage ring. In order to demonstrate the X-ray generation using a pulsed-laser stacking cavity, we have constructed the linac to produce the multi-bunch e<sup>-</sup> beam with the energy of 43MeV and the charge of 200nC/100bunches. This paper reports the present status of this linac.

# KEK小型電子加速器(LUCX)の現状報告

## 1. はじめに

現在、X線は医療、生命科学、材料科学など広い 分野で利用されている。例えば、動的血管造影では 患者の体内にヨウ素を注入し、ヨウ素のKエッジ

(33.169keV)前後のエネルギーの硬X線を照射し、 それぞれの像をとる。Kエッジの前後で散乱断面積 が大きく変わるので、その前後のエネルギーの透過 X線のコントラストをとることにより、血管の鮮明 な像を得ることができる。また、タンパク質の構造 解析などにも利用される。これらの利用には安定し た高輝度X線源が必要である。このためのX線源と しては、GeVオーダーの電子蓄積リングでのアン ジュレータを利用したもの(SPring8など)がある。こ れは、高輝度で、高い安定性をもつが、一般的に装 置が巨大で高価であり、使用できる場所は限られて いる。もっと小型で安価な高輝度X線源が実現し、 病院、大学、企業なども導入できるようになれば、 放射線医療、研究、産業の発展に大きく貢献するこ とができる。

そこで、我々はコンプトン散乱を利用した小型高 輝度X線源の開発研究を高エネルギー加速器研究機 構(KEK)に設けた小型加速器で行っている。これは、 医療用小型高輝度X線源の開発として放射線医学総 合研究所と共同で製作したものである。最終的な装 置構成は、周長約13mの小型の蓄積リング中にレー ザー蓄積装置を設置したものになる[1]。この装置で は赤外(1064nm)のレーザーパルスと43MeVの電子 ビームとのコンプトン散乱により33keVの硬X線を 生成する。コンプトン散乱を利用することにより、 より低いエネルギーの電子ビームで硬X線を作るこ とができる。このため蓄積リングの小型化が可能に なり装置がコンパクトとなるため、比較的安価に高 輝度X線源を製作することが可能になって来る。た だし、コンプトン散乱の断面積は小さいのでX線数 を増やすために、レーザー、電子ビームとも密度を 上げて衝突させる必要がある。レーザーに関しては、 ピークパワーの高いパルスレーザーを作り出すため に、2枚の凹面ミラーからなる光共振器であるレー ザー蓄積装置を用いる。共振器長をレーザーのパル ス間隔の半分にすることで共振器内にピークパワー の高いパルスを蓄積でき、また凹面ミラーを使うこ とで光共振器中心で横方向のサイズを100 µ m以下 に絞ることもできる。また、電子ビームに関しても、 高強度であることと共に、衝突点でできるだけ小さ くビームサイズを絞るため、質のよい(エミッタン スの小さい)ことが重要である。

そこで、我々は高品質で大強度のマルチバンチ電

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: mfukuda@post.kek.jp

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Present address: Japan Atomic Energy Agency

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Present address: Laboratory of Nuclear Science, Tohoku University

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Present address: Japan Atomic Energy Agency



図1 小型電子加速器ビームライン

子ビーム源の開発をKEKに設けた小型電子加速器で 行っている。昨年11月まで第1段階として電子源の 開発を行った。電子源としてフォトカソードRF電 子銃を採用した。これは、高品質なビームを得られ、 さらにレーザーのバンチ構造をそのまま引き継ぐた め、バンチャーなどの装置が不要となり、ビームラ インを小型化でき、マルチバンチビームも容易に生 成できるためである。カソードとしてモリブデン表 面に金属カソードに比べて量子効率の高いCs-Teを 蒸着したものを使用した。レーザーの入射パワーと 電子ビームの電荷量から計算するとカソードの量子 効率は0.3%以上を保持していた。このRF電子銃を 用いた大強度マルチバンチ電子ビームの生成の実験 では、250nC/train、100bunches/trainのマルチバンチ 電子ビームの生成に成功した[2]。現在は第2段階と して、ビームエネルギーを5MeVから43MeVまで上 げ、レーザー蓄積装置を用いた逆コンプトン散乱に よるX線生成実験を行う予定である[3]。このため加 速管とレーザー蓄積装置を設置する部分を追加する ビームラインの改造を2005年11月から行った。建設 は2006年3月末に終了し、エージングを開始した。 また、7月中旬からビーム運転を開始したところで ある。本稿では、この小型電子加速器について報告 する。

# 2. 小型電子加速器

2.1 ビームライン

図1は小型電子加速器のビームラインである。電子源には引き続きフォトカソードRF電子銃を採用している。レーザーパルス(266nm)はシケインの部分からカソードへ垂直に入射する。RF電子銃で生成した4MeVの電子ビームはS-band 3m加速管で

表1 筒	電子ビ	ームのノ	ペラ	メータ
------	-----	------	----	-----

Energy	43MeV	
Intensity	2nC/bunch	
Number of Bunches	100 bunches/train	
Bunch spacing	2.8ns	
Bunch length	10ps	
Repetition Rate	12.5 train/s	

43MeVまで加速する。その下流にはX線生成を行う 部分があり、衝突点にはレーザー蓄積装置を設置す る。加速管直前と衝突点前後には四極電磁石を設置 した。加速管直前のものは加速管内でのビームサイ ズを小さく保つためと下流の四極電磁石でのビーム サイズを大きくして衝突点でのビームサイズをなる べく小さく絞るためにある。衝突点上流のものはそ こでビームサイズを収束するため、その下流のもの は収束したあと広がるビームを抑えビームダンプま で輸送するためである。最後は偏向電磁石でビーム を垂直下方に設置したビームダンプに捨てる。ビー ムダンプ直前には電子ビームのエネルギーやチャー ジ量を測定するためにプロファイルモニタとICTを 設置した。また、各所に電子ビームの位置やサイズ を測定するためのBeam Position Monitor やプロファ イルモニタを配置している。X線は偏向電磁石の後 方より厚さ0.3mmのBe窓を通して大気中に取り出す。 ビームラインの全長は約11mである。電子ビームの パラメータは表1のようになっている。また、この ビームラインのオプティクスはSAD (Strategic Accelerator Design)[4]を使って設計した。衝突点で の電子ビームサイズは $\sigma_x=64 \mu m$ ,  $\sigma_y=32 \mu m$ と計算 されている。またX線検出に際してビームロスによ るバックグラウンドを抑えるため、全体を通して ビームサイズが3mm 以下になるようにした。

## 2.2 RF system

図2はRF systemである。Klystronは東芝製E3718 を使用しており、この1台でRFgunと加速管に RF(2856MHz)を供給している。Klystronからの



47MWの出力電力は、進行波型RFパルス圧縮器 RRCS(Resonant-Ring type Compression System)[5]で ピーク電力を3.25倍に増幅される。その後、 RFgunと加速管の両方へ分配し、それぞれ最大 ピーク電力53MW、46MWを供給する。大電流の マルチバンチビームを作るときに問題となるのは, ビームローディングにより、バンチ列の前方と後 方でエネルギー差が出来てしまうことである。 200nC/train, 100bunches/trainのマルチバンチビー ムが高周波が定常状態になったときに、加速管に 入射すると、18MeVのエネルギー差が生じる。電 子ビームを100 µm以下に絞りレーザーと衝突さ せるにはエネルギー差を1%以下に抑える必要が ある。これを補正するため、高周波が空洞内に満 たされつつある過渡期に入射することで、後ろの バンチほど、入射時の高周波による電場が高い状 態にし、ビームローディングの影響を相殺する。 ただし、過渡期に入射するとその分ビームエネル ギーが下がってしまう。それを補うためにRRCS を用いピーク電力を上げて必要なビームエネル ギーを得られるようにする。

図3は加速管出口でのビームエネルギーで、青線が100bunchesを入射した時のビームトレインのエネルギーである。パルス圧縮部の始めから0.2usのところにビームを入射すると補正できるのが分かる。このときエネルギー差は1%である。



#### 2.3 Laser system

レーザーシステムは図4のようになっている。波 長1064nmの7W, 357MHz, Nd:YVO<sub>4</sub>モードロックパ ルスレーザー(Time-Bandwidth Products GE-100-1064-VAN-XHP)をシードレーザーとし, 100バンチ (280ns)を切り出すためのポッケルセル(KD\*P), 2台 のフラッシュランプ励起のNd:YAGアンプ,赤外光 を紫外光に変換する2つのBBO結晶(SHG,FHG)から なる。ポッケルセルで切り出された100バンチの レーザーパルス列はそれぞれのアンプを2回通過し, 約2000倍に増幅され,BBO結晶で紫外光へと変換さ れる。赤外→紫外の変換効率は約25%,パルスあた りのエネルギーが10 µ J/pulse の100バンチレーザー パルスを生成する。パワージッターはr.m.s.で約3% となっている。



図4 Laser system

# 3. 現在までの運転状況と今後

今年3月末にビームラインの建設が終了しRFエー ジングを開始した。現在は約400時間行いKlystron出 力電力23MW, RF電子銃、加速管へのピーク入力電 力約30MWで安定に運転できるようになっている。 RF電子銃には約10MW入っている。この出力で7月 中旬よりビーム運転を開始し、38MeV, 30nC, 100bunchesのビームをビームダンプまで輸送するこ とができた。そのときのICTで測定したビーム電流 の信号が図1の波形である。まだ、RFの入力電力が 設計値より低いので、ビームエネルギーを上げるた め、RFに対するビームの入射タイミングを後ろに ずらして運転している。エミッタンスなどのビーム パラメータの測定はこれからであり、そのための測 定系の確立を行っていく。今後、ビームローディン グを補正しつつ、43MeV, 100バンチ, 200nCの電子 ビームを生成するには、RF電力を設計値まで上げ る必要があり、ビーム運転と共にRFエージングも 継続し、目標のビーム生成を目指す。

## 参考文献

- J. Urakawa, et al., "Electron beam cooling by laser", Nucl. Instr. and Meth. A532, pp388-393 (2003).
- [2] K. Hirano, et al., "High-intensity multi-bunch beam generation by a photo-cathode RF gun", Nucl. Instr. and Meth. A560, pp233-239 (2006).
- [3] K. Sakaue, et al., "Laser Undulator Compact X-ray source (LUCX) using pulsed-laser stacking cavity", in this meeting.
- [4] SAD http://acc-physics.kek.jp/SAD/sad.html
- [5] S. Yamaguchi, et al., "High-Power Test of a Traveling-Wave-Type RF-Pulse Compressor", Proc. PAC1995, Dallas, USA (1995) pp1578-1580